⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平

平2-19847

Slnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成2年(1990)1月23日

6 03 F

7/022 7/004 7/38 7267-2H 5 1 5 7267-2H 5 1 1 7267-2H

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全7頁)

60発明の名称

ポジチブ及びネガチブ処理感放射線混合物及びレリーフパターンの

作製方法

②特 願 平1-115256

烝治

@出 願 平1(1989)5月10日

優先僱主張

図1988年5月19日図西ドイツ(DE)図P 3817012.4

個発明 者

ラインホルト、シユヴ

ドイツ連邦共和国、6706、ヴアヘンハイム、アム、ヒユツ

テンヴィンゲルト、53

の発 明 者 ホルスト、ピンダー

ドイツ連邦共和国、6840、ラムベルトハイム、ヘンデルシ

ユトラーセ、3-5

⑪出 願 人 ピーエーエスエフ ア

アルム

クチエンゲゼルシヤフ

ドイツ連邦共和国、 6700、 ルードウイツヒスハーフエ

ン、カール・ボツシユ・ストラーセ、38

ト

②代理人 弁理士田代

(y) A(1) 1

1. 発明の名称

ポクチブ及びネガチブ処理感放射線混合物 及びレリーフパターンの作製方法

2. 特許請求の範囲

②請求項(1)による成故射線混合物であって、ポリマー結合剤(a) においてポリマー中に当初から存在するフェノールヒドロキシル基の 1 0 乃至

100%をツヒドロピラン或はアルキルピニルエーナルと反応させることを特徴とする混合物。

(3) 上記到東京の何れか 1 項による感放射線混合物であって、ポリマー結合剤(a) としてロークレソール/ホルムアルデヒドを主体とする / ポラックと ツヒドロピラン 取はアルキルビニルエーテルとの 反応生成物が 使用 されることを特徴とする混合物。

(4) 野東項(1) 或は 20 による 23 放射線 混合物であって、ポリマー結合剤(a) として、ポリー(pーヒドロキシームーメチルスチレン)、 ポリー(pーヒドロキシームーメチルスチレン)、 或はpーヒドロキシスチレン/pーヒドロキシーαーメチルスチレン 共重合体と、ジヒドロビラン或はアルキルビニルエーチルとの反応生成物が使用されていることを特徴とする混合物。

切上記額求項の何れか l 項による盛放射線 混合物であって、有機化合物 (b)として、一般式(l)

(式中型、PR及びPは互いに同じであっても異ななってもよく、それぞれ場合によりへテロ頭子を含有する助助族及び/或は芳香族基を意味し、或は PP 至 PP の 2 個が互いに結合して関を形成するが、 PP 至 PP の 2 個が互いに結合して関を形成するが、 PP 至 PP の 2 の かなくとも 1 個は少なくとも 1 例の、酸により分裂可能の基を有し、 PP 至 PP の 1 個は 1 個域は複数個の 3 らに他のスルホニウム塩 甚と、場合により 般により分裂可能の 5 を介して、結合されることができ、 P は非 求 核性反対イオンを意味する)のスルホニウム塩が使用されることを特徴とする混合物。

63 上記額 求項の何れか 1 項による感放射線配合物が使用されることを特徴とする、レリーフバターン及びレリーフ 面像を作製する方法。

の請求項的によるポッチブレリーフバターンの作製方法であって、 略放射線混合物の部光後 8 0 乃至 9 0 での温度に加熱し、次いでアルカリ作項 健剤で現象することを特徴とする方法。

四線水項的によるネガチブレリーフ作製方法であって、路放射線混合物の電光後120万平200

一次的光反応で成る化合物をもたらし、これが放射線と原関係に二次的触媒反応を誘起させる密放射線組成物の感应向上も同様に公知である。例えば米国特許3915706 号明和雪には、強酸を形成し、次いでこれが二次的反応で酸安定法、例えばポリアルダヒド基を分裂させる光開始剤が開示されている。

での温度に加熱し、次いでアルカリ性現象剤で現 促することを特徴とする方法。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本売明はポリマー約合形と、少なくとも1個の酸により分裂可能の結合を有し、放射線の作用下に強酸を形成し、アルカリ水溶液に対する溶解性が酸の作用により高められる有機化合物とを含作するポッチブ及びネガチブ処理感放射線混合物に関するものである。このような混合物は紫外線、電子線及びX線に対して感応し、ことにレッスト材料として適当である。

(従来技術)

ポッチブ処理感放射線混合物は公知である。ことに、アルカリ水溶液に可溶性の結合剤、例えばノボラック波はポリー(pービニルフェノール)エンにoーキノンジアジドを含有するポッチブ処理レジスト材料は函薬的に使用されている。しかしながら、このような感光性組成物はことに短波及放射線に対する感度が部分的に不十分である。

Coatings and Appin.Polym.Sci.48 (1985) 85-69 頁におけるクリベロ (Crivello) の論 称中に 概 説 されている。この光明 始 剂の欠点は、 放射 線 の 作 用により、 勝を形成する以外には、 アルカリ 作 現 使 剂に 対する 溶解性を 高めるべき さらに 他の 光化 学生成物をもたらさないことである。 さらにこの 混合物は上記 3 成分を必須とすることである。

酸安定側額茲 t ープチルカルボナート 取は t ープチルエステルを有する ボリマーと、光化学的酸低与体とを有する 感放射線混合物は、例えば火型特許 4491628 号及び仏国特許山駅 2570844 号公復から公知である。この混合物はボクテブ処理もネガチブ処理も可能であって、極性溶媒でも非極性溶媒でも現象される。

またチトラヒドロピラニルエーテル、酸低与光 関始剤及び場合によりポリマー結合剤を含化する 感光性記録材料(四独特許出版2306248 号公和) も公知である。この混合物はポクチブ処理のみで ある。

さらにフェノール樹脂、特殊なノポラック及び

オニゥム塩から成る ポッチス 及び キガチブ処 ほ 記 合物 も 公 知 で ある。 この 混合物 は 故 射 線 部 光 近 処 理 サ る。 またこの 混合物 を 加 熱 し て れに より 深 光 質 域 を アルカリ 性 現 像 剤 に は り 非 郡 光 領 域 を アルカリ で と に よ り 非 郡 光 領 域 を なん カリ 可 溶 性に 変え、 しか る 徳 に アルカリ 現象 放 か か か り 現 な な な で た は 顕 148411号 公 報)。 し な が ら 、 ポッチブ 処 理 す る く か ら 、 ポッチブ 処 理 別 合 物 は 感 変 が ある。 し て は 処理 工 程 数 が 多 過 ぎ る と い う 欠 点 が ある。

四独特許出頭 3721741 号公報には、アルカリ水 密放に可溶性のポリマー結合剤と、水性アルカリ 現象剤に対する溶解性が股の作用により高められ、酸による分裂可能の基を少なくも1 個合行 し、放射線作用下に強度を形成する有機化合物と を含有する感放射線混合物が記載されている。こ の混合物はネガチブ処理される。

本発明の目的乃至課題は、アルカリ水溶液で現役され、しかもポジチブ処理もネガチブ処理も可

上記ポリマー結合剤(a) 中において、ポリマー中に当初から存在するフェノールとドロキシル語の10万至100%をジヒドロピラン或はアルキルビニルエーテルと反応させることが好まししていった。 はりっし おっかい ないが カー に サー (p) ー と ドロピラン 或は ポリー (p) ー と ドロキンステレン、 或は プリーと ドロキシー なーメテレン は プリーと ドロキシンの 共 遺合体 と で シーローメテル ピニル なった じっと びん で り ー と ドロキシンの 大 遺合体 と の 反応生 依 物 を 使用するのが 評ましい。

上記有機化合物 (b) として一般式(I)

(式中 P'、 P'及び P'は 互い に同じ であって も 具 ななってもよく、 それぞれ 場合により ヘテロ 原子を含有する 節助 族及び / 或は 芳香 族 基を 意味 し、 或は P'乃 至 P'の 2 個 が 互いに 結合して 環を形成する

飽な、レリーフパターン作製用の高店性感放射線 組成物を提供することである。

(類明の変約)

しかるに何らの追加的処理工程を必要とすることなくポッチブ処理もおがチブ処理も可能な、高路度のアルカリ現像し得る感放射線混合物が水売朝により協供され得ることが見出された。

が、ピ乃至ピの少なくとも1個は少なくとも1個の、酸により分裂可能の基を存し、ピ乃至ピの1個は1個或は複数個のきらに他のスルホニウム塩 返と、場合により酸により分裂可能の基を介して、結合されることができ、X⁹は非求核性反対イオンを感味する)のスルホニウム塩を使用するのがことに好ましい。

本発明は、また上記の如き本発明による感放射線混合物を間形成材料として使用すレリーフパターン及びレリーフ面像の作製方法もその対象とする。

本発明によるほ放射線混合物を露光後、 8 0 乃至 9 0 での温度に加熱し、次いでアルカリ現像剤で現像することにより、ポッチブレッストバターンが得られる。 光後に 1 2 0 乃至 2 0 0 での温度に加熱することによりネガチブレッストバターンが得られる。

木発明感放射線混合物の各組成分を以下に逐一 説明する。

(発明の構成)

本苑切に使用されるポリマー結合剂(a) を製造するための出発材料としては、フェノール供脂、例えばノボラック、ことにロークレゾールノホルムアルデヒドを主体とするノボラック、ポリー(ローヒドロキシスチレン)、ポリー(ローヒドロキシスチレン)、 成はローヒドロキンスチレングローヒドロキシー αーメチルスチレン共血合体が挙げられる。これらは全体的或はアルキルビニルエーテルとで、次にツヒドロピラン 改はブヒドロピラン 及びで、変し、の場合には、一般式(Ⅱ)の基が導入される。

式中Rは水素或は炭素原子1乃至3個を有する

ン、 p - (チトラヒドロピラニルーオキシ) - スチレン及び p - ヒドロキシーα - メチルスチレンが計ましい。

アルキルビニルエーテルとしては、1万至8個の、好ましくは2万至8個、ことに2万至4個の 炭素原子をアルキル基中に有する、直鎖、分枝或は環式のものが符げられる。ことに呼ましいのは フェノールヒドロキン基を有する紹合物或は至合体をジヒドロビランとにより変換したものである。

本発明においてポリマー結合剤におけるフェノールヒドロキシル基の10万至100%、ことに15万至30%が、アルキルビニルエーテル或はソヒドロビランでエーチル化されるのが打ましい。

アルキルを立味する。

ノボラック (出発材料) としては、例えば「ソリッド、スティト、テクノロジー」 1884年 8 月号 115-120 頁における T. パンパローン (Pampalone) の論稿「ノボラック、レジンス、ユーズド、イン、ポジテブ、レジスト、システムズ」に記載されているものが使用される。特殊な用途、例えば短波長紫外線露光用には、ロークレゾール及びホルムアルデヒドからノボラックが好ましい。

次いでノボラックは、例えばエチルアセタート中において、触媒的量の堆積の存在下に、ジヒトロピラン政はアルキルビニルエーテルと反応せしめられ、フェノール OH 基が全部改は部分的に代替される。

ヒドロキシスチレンを主体とするフェノール 樹間は、慣用の方法により何々の不飽和モノマーを
ラリカル共孤合政はイオン 共孤合して 製造される。 共重合せしめられるべき 不飽和コモノマー
は、 置換或は非置換ヒドロキシスチレン、 例えば
pーヒドロキシスチレン、 mーヒドロキシスチレ

共重合体(a) の組成はH-NKR スペクトロスコープにより測定される。

有機化合物(b) としては、少なくとも1 例のスルホニウム塩基と、少なくとも1 個のとープチルカルボナート基或は少なくとも1 個のシリルエーテル基とを含有するものが好ましい。しかしながら、放射線照射により強酸を形成し、同一分子内に酸により分裂可能の基を含有するものであれば上記以外の化合物も使用され得る。

好ましいこのような有機化合物は一般式(1)

で表されるものである。

P'、PP及びPは互いに同じであっても異ななってもよく、それぞれ場合によりへテロ原子を介する動助族及び/或は芳香族基を意味し、或は F'乃至 PPのうちの 2 個が結合して環を形成するが、 R' 乃至 PPの少なくとも 1 個の Q に

より分裂可能の法を含むし、PI乃至PPの1個は1 個並は複数個の他のスルホニウム塩芯と、場合に より酸により分裂可能の基を介して、結合される ことができ、XOは非次核性反対イオンを意味す る。具体的には例えば反対イオンとしてヘキサフ ルオロアルセナート、ヘキサフルオロアンチモナ ート、ヘキサフルオロホスファート及び/皮はヘ キサフルオロカルポナートを行するジメチルー 4 ーセーブトキシカルポニルオキシフェニルースル ホニウム塩、上記反対イオンを有するフェニルー ピスー (4-t-ブトキシカルポニルオキシフェ ニル)ースルホニウム塩、上記反対イオンを介す るトリスー (4-t-プトキシカル ポニルオキシ フュニル)ースルホニウム塩、上紀反対イオンを 育する4ーヒドロキシフェニルーピスー(4-t - ブトキシカルポニルオキシフェニル)ースルホ ニウム塩或は上記反対イオンを有する1-ナフチ ルー4ートリメチルシリルオキシテトラメチレン ースルホニウム塩である。

ことに好ましい有機化合物(b) は一般式(II)

254mmラインが使用され、また248mm(KrF)のエキシマレーザ光が使用される。従って感放射線記録材料はこの放及形域においてなるべく低い光学密度を待たねばならない。このような用途のためにはノボラックを主体とする本発明におけるボリマー結合剤は、ヒドロキシスチレンを主体とするポリマー結合剤がこの特殊な用途のために使用される場合に比し不適当である。

ポッチブレリーフパターン作製のための本別明方法においては、本質的に本鬼明感放射類混合物から成る感放射類記録別は、800万至90℃の温度に加熱することにより電光領域の水性アルカリ治媒に対する溶解性が増大せしめられ、この深光領域が水性アルカリ現像別により選択的に洗除され得る程度に顕像形成露光される。

キガチブレリーフパターン作製のための本列切力法においては、磁放射線記録層は、120万万至200℃の温度に加熱することにより臨光領域の水性アルカリ現像剤に対して最早溶解しなくなる

で汲されるものである。 R は水梨、 t ーブトキシカルボニル及び/汲はトリアルキルシリルを意味するが、 R のうち少なくとも 1 倒は水器であってはならない。

上述スルホニウム塩の製造法は、例えば函数特許出願公園 3721741 号及び 3721740 号公根に起根されている。

この有機化合物(b) は、本発明混合物中組成分(a) と(b) の合計量に対して、一般に2乃至30 重益%、ことに5乃至20重量%含有される。

本発明感放射物混合物は、 X 切、 電子ビーム、 紫外線に対して感応する。 足被 選 紫外線から可視 光線被長域まで感応するように、 場合により 微量 の地感剤、例えばビレン、 ペリレンを添加するこ とができる。 特殊な被長 範囲、 例えば短波 長紫外 類 帯域(く300nm)における 露光のため、 それぞれの 露光波 長における 高い 遺明 度が 要求される。 水銀灯を主体とする 慣用の 露光 装置においては

頭により逆に水性アルカリ現像剤により完全に洗 錠される。

フェノール系モノマー組成分の10万至100 %がアルキルビニルエーテル或はツヒドロピラン と反応せしめられたポリマー結合剤(a)、例えばポリーローヒドロキシステレンと、組成分(a)と (b)の合計量に対して5万至20重量%、ことに 5乃至15重量%の化合物(b)とを、適当な不活性的媒、例えばメチルグリコールアセタートに溶 解させ、個体分合有量を10万至30重量%となるようにする。

このお被を0.2 μm 網目のフィルターで認過する。このレジスト溶液を1000万至10000 rpmの回転数でウェハ(例えば要面を酸化させた珪素ウェハ)上に遅心力強而して、レジストフィルム(厚さ約1 μm)を形成する。このウェハを90万至80℃で1万至5分間加熱する。形成層をクロム被辺石英マスクを介して水銀灯紫外線、エクシマレーザー光、電子ビーム或はX線により露光処理する。

部光間を80万至80でで5秒万至2分間、波は120万至200でで10秒万至2分間加熱する。このように熱処別された固をアルカリ現象がで現像処理し、80万至80での低温熱処理をした場合には部光領域が選択的に溶解洗験され、120で以上の高温熱処理した場合には非解光領域が選択的に溶解洗験される。

現象剤としては市販の、例えばナトリウムヒドロキシド、珪酸ナトリウム、珪酸カリウム或はテトラアルキルアンモニウムヒドロキシドを主体とする市販のものが使用される。

本売切底放射線配合物は、ことに高感度、良好な解放度、処理の容易性を示し、従って短波長紫外線によるリトグラフィーに特に避する。

以下の実施供における部及びパーセントは明示されない限りすべて血量部及び血量%である。

ポリマーの合成

分子型 No (光散器)62000g/モルのポリー(p ーヒドロキンステレン) 2 都をエチルアセタート 2 0 部に折解させる。これにジヒドロピラン 1 0

ングリコールアセタートからフォトレジスト溶液 を興製する。この溶液を0.2 μ a 観目のフィルタ ーで組造する。

(リトグラフィー試験)

(a) オジチブ技

レリスト海放を7900rpm の回転数でSIOm被回往 繋ウェハ上に進心力生布し、1.07μm 厚きの固を 形成する。このウェハを80℃で1分間乾燥し、 次いでテストマスクを通して放長248mmのエキ シマレーザー光で15秒間接触法で画像形成電光 に付し、次いで70℃で80秒間無処理し、アル カリ及像剤(pH値12.3)で80秒間現像処理す る。露光領域は完全に洗験され、マスクのポツチ ブ間像を有するレリストバターンが得られる。底 度は100mJ/cm²である。

(b) ネガチブ法

上記(m) のようにしてレジスト溶液を違心力物 布し(歴度さ1.005μm)、90℃で1分間加熱する。次いでテストマスクを接触装着し、放長24 8 nmのエキシマレーザー光で20秒間面像形成質 部及び適塩酸 0.5 部を添加する。この混合物を窒温において 8 2時間反応させ、次いでリグロイン中に 沈鷺させる。生成ポリマーを 粉釈炭酸 水 常ナトリウムで洗やし、 5 0 で減圧下に 乾燥する。 その 1 Rスペクトロープ及び F-MMR スペクトロープ分析により、フェノール CHが完全にエーテル 化されており、ポリー(ローヒドロキンステレン)のテトラヒドロピラニルエーテルの形成されていることが認められる。

同様にしてそれぞれ理論型のジヒドロピランを 添加して、部分的にエーチル化されたフェノール 基を存するポリマーが型置される。

皮施例 1

(レジスト治紋の調製)

1 0 部のトリスー(4-t-ブトキシカルボニルオキシフェニル)-スルホニウムヘキサフルオロアルセナート、8 0 部の、p-ヒドロキシステレン/p-2-テトラヒドロピラニル-オキシステレン(7 5: 2 5.)共血合体(分子面 In = 22000g/モル(GPC))及び40 0 路のメチルプロピレ

光し、次いで120℃で1分間熱処理する。アルカリ性現像剂(pH12.3)により80秒間現像すると、非常光領域は完全に洗除されるが、露光領域は対1μmの厚さの圏が投存する。感度は70mJ/cm²で、マスクのネガチブバターンが形成され

実施税2

10部のトリスー(4-t-ブトキシカルボニルオキシフェニル)-スルホニウムヘキサフルオロホスファート、90部の、pーヒドロキシスチレン/p-2ーテトラヒドロピラニル-オキシスチレン(90:10)北瓜合体(分子型Nn=16500g/モル(GPC))及び400部のメチルプロピレングリコールアセタートからフォトレジスト的被を製製する。次いでこの溶液を0.2 μョ 網目のスクリーンで認過する。

このレジスト溶液を9820rpm の回転数でS10a被 個達器ウェハ上に違心力型布して0.98μm 厚さの 個を形成する。このウェハを80℃で1分間空場 し、次いでチストマスクを接触装登して被長248 nmの、エキシマレーザー光で15秒間面な形成露光し、次いで80℃で60秒間熱処理する。pH値 12.3の現像被で80秒間現像処理すると、露光領域は完全に洗除され、マスクのポジチブ再生画像を行するレリーフパターンが得られる。建度は250ml/cm²である。

上記録合物を 1 2 0 ℃で無処理すると相当する ホガチブパターンが切られる。 感度は 1 0 0 mJ/ cm²である。

代理人并理士 田代 悉 治